NOTE FORUM **(Korea)**

EV Group announces nanoimprint solution 'EVG7300' - January 19, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. This industry-ready, multi-functional system is designed to serve advanced R&D and production needs for a wide range of emerging applications involving micro- and nano-patterning as well as functional layer stacking. Supporting wafer sizes up to 300 mm and featuring high-precision alignment, advanced process control and high throughput, the EVG7300 meets the high-volume manufacturing needs for a variety of freeform and high-precision nano- and micro-optical components and devices.

NOTE FORUM 디지털 모바일 IT 전문 정보, 노트포럼 검색

크로스오버 | 게이밍 노트북 | MSI | 노트북 | 한성컴퓨터 | 레노버

종합 IT정책 노트북 스마트패드 · 폰 디지털이미징 A/V 가전 컴퓨팅 소프트웨어 포럼통신 텍스트

공지사항 & 이벤트 MORE

회원가입 및 로그인 오류 안내
서버 확장 이전 및 안정화 작업 안내
넉넉하고 풍요로운 추석 되시길 바랍니다.
노트포럼, 여름 휴가 떠납니다

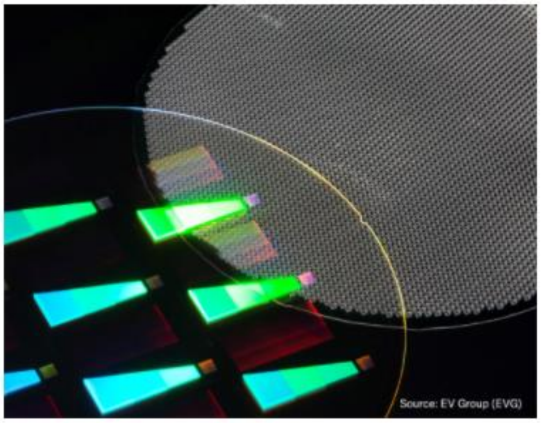
EV그룹, 나노임프린트 EVG 7300 출시

기사입력 : 2022-01-19 | 컴퓨팅

김현열 기자 : goora@noteforum.co.kr

단축URL복사

EV그룹은 자동화된 SmartNIL 나노임프린트 및 웨이퍼 레벨 광학 시스템인 EVG 7300을 출시한다고 밝혔다.



EVG의 최신 솔루션인 EVG7300은 나노임프린트 리소그래피(NIL), 렌즈 몰딩 및 렌즈 스태킹(UV 본딩) 같은 UV 기반의 여러 프로세스를 단일 플랫폼에 결합한 것이 특징이다. 이 산업용 다기능 시스템은 마이크로 및 나노 패터닝은 물론 기능 레이어 적층 등을 포함하는 광범위한 신규 애플리케이션의 첨단 R&D와 생산 공정 모두에 사용될 수 있다. 이러한 애플리케이션의 사례에는 웨이퍼 레벨 광학(WLO), 광학 센서와 프로젝터, 차량용 조명, 증강 현실(AR) 헤드셋용 웨이브가이드, 바이오 의료 장비, 메타 렌즈와 메타 표면, 광전자 기기 등이 포함된다. 최대 300mm 웨이퍼까지 지원하고 고정밀 얼라인먼트, 향상된 프로세스 제어, 우수한 쓰루풋 성능을 자랑하는 EVG7300은 다양한 자유도와 높은 정밀도로 나노 및 마이크로 광학 부품과 기기를 대량 생산하고자 하는 사용자의 요구를 충족한다.

EVG7300은 독립된 툴로서 사용하거나, 또는 EVG의 HERCULES UV-NIL 트랙 솔루션에 하나의 모듈로 통합해 사용할 수 있다. EVG의 HERCULES UV-NIL 트랙 솔루션은 사용자의 특정 프로세스 요건에 따라서 세정과 레지스트 코팅 및 베이킹 같은 전처리 공정이나 후처리 공정을 추가할 수 있다. 또한 EVG7300은 업계 선도적인 얼라인먼트 정확도를 제공한다(300nm까지). 이는 향상된 얼라인먼트 스테이지, 고정밀 광학계, 멀티포인트 갭 제어, 비접촉식 갭 측정, 멀티포인트 포스 제어 등 다양한 방법의 조합 덕분에 가능해진 것이다. 또한 EVG7300은 유연성이 매우 뛰어난 플랫폼으로서, 세 가지 공정 모드(렌즈 몰딩, 렌즈 스태킹, SmartNIL 나노임프린트)를 지원하고 150mm부터 300mm까지 이르는 웨이퍼 크기를 지원한다. EVG7300은 신속한 스탬프와 웨이퍼 로딩, 고속 얼라인먼트 광학계, 고전력 경화, 소형화된 툴 풋프린트로 업계에서 새롭게 떠오르는 WLO 제품의 제조 요구를 충족하는 매우 효율적인 플랫폼을 제공한다.

http://www.noteforum.co.kr/news/index.htm?nm=51877